

适用于MEMS 微镜的SCHOTT MEMpax®

背景信息

生产高质量、持久耐用的 MEMS 微镜的部分主要标准取决于所用材料。其中一个标准是玻璃的物理性能。通过阳极键合可以将玻璃和硅牢固地结合在一起，因此玻璃和硅通常联合使用。

要最大限度地减少因键合界面处热差异而产生的应力，这两种材料必须具有相同的热膨胀系数 (CTE)。

MEMS 微镜需要基板能同时适用于反射镀膜和增透镀膜，以实现最佳功能。

我们的解决方案：MEMpax®



热膨胀与硅的
精确匹配

适用于
阳极键合

极高的
透光率

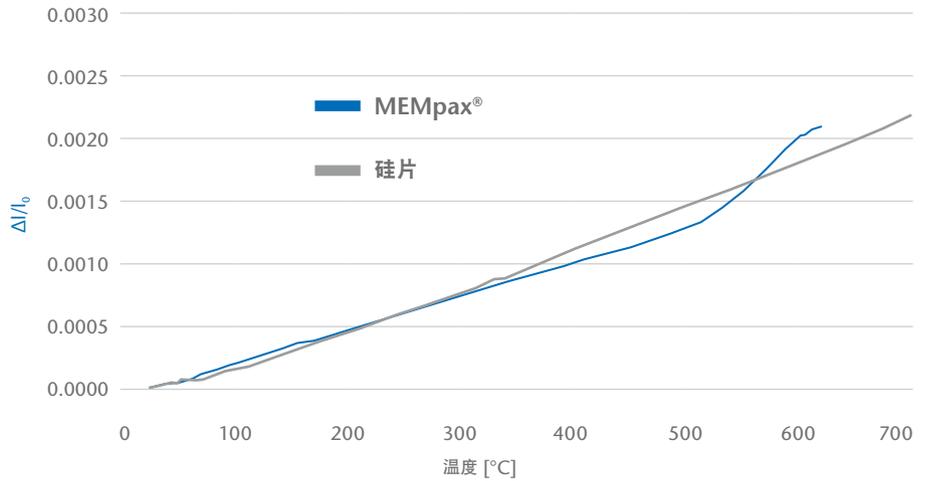
出色的抗热震
和机械性能

是反射镀膜和增透
镀膜的最佳镀膜
基板

无需对基板进行研磨
或抛光，因此无
表面或表面下损坏



基于初始长度 $\Delta l/l_0$ (升温速率为 5 K/min) 的动态延伸率



SCHOTT MEMpax® 的技术数据

尺寸	2" – 12" (圆形或矩形)
表面粗糙度 R_a	< 0.5 nm
厚度*	0.07 mm – 0.55 mm
标准厚度*	0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm
透光率 τ_{VD65} (厚度 = 0.5 mm)	92.9%
平均线性热膨胀系数 α (20°C; 300°C) (统计测量)	$3.3 \times 10^{-6}/K$

* 可根据要求提供其它厚度



扫微信二维码
关注肖特 SCHOTT

肖特 (上海) 精密材料和设备国际贸易有限公司
上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 301 室
电话 +86 (0)21 33678000
传真 +86 (0)21 33678080
info.china@schott.com

www.schott.com/special-glass-wafer/chinese

SCHOTT
凝智慧 享未来 肖特科技